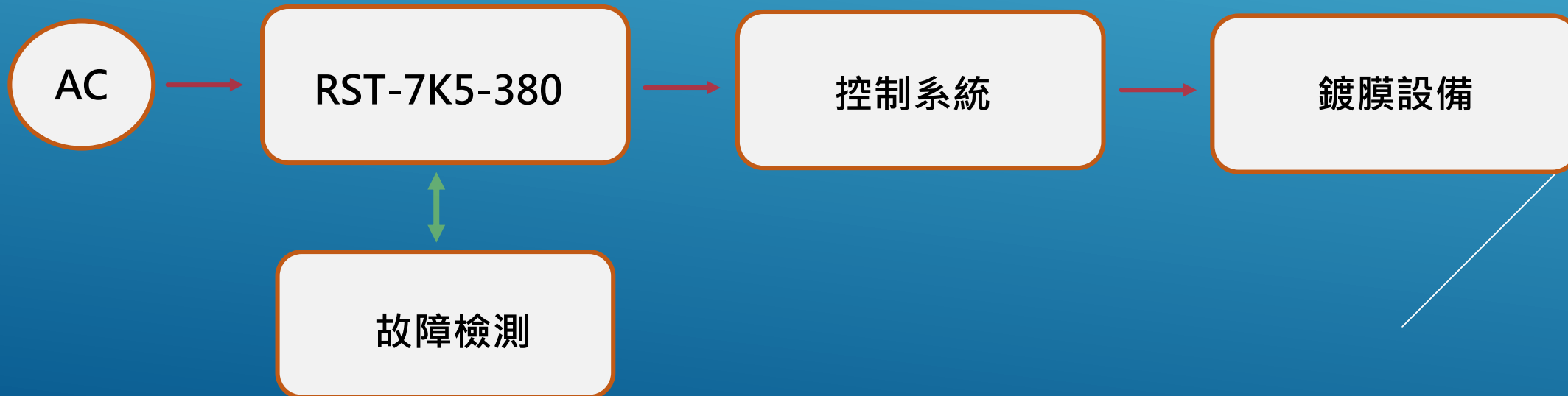


真空鍍膜設備系統解決方案

- 應用領域：真空鍍膜設備
- PSU/Model：RST-7K5-380
- 系統電壓: 400VDC
- 控制介面: 警報信號 (監控DC OK, AC fail, fan fail, OTP)



應用說明:

真空鍍膜設備的工作方式是在等離子室內放置一個較強的電磁場，這種電磁場通過射頻輻射將氣體變成等離子體，等離子體是一種含有很多高能粒子的狀態，這些高能粒子會撞擊到我們想要鍍膜的材料上。撞擊後，這些材料的一小部分會被擊飛出來，並沉積在我們想要鍍膜的物體表面上。這些被沉積的材料會形成一層薄薄的膜，可以是金屬的，也可以是非金屬的。簡而言之，真空鍍膜設備是通過在強電磁場中使氣體變成等離子體，然後利用高能粒子撞擊材料并將其薄薄地塗覆在物體表面上，從而形成各種薄膜

本案以RST-7K5-380提供穩定的400VDC輸出給控制系統進行供電，透過控制系統處理，可依據不同鍍膜材料需求，提供相應電壓（方波或正弦波）與頻率給鍍膜設備

產品選擇與亮點

- 並聯功率可達28500W
- 具備遙控開關/遙感/12Vdc輔助電源功能
- 提供AC fail, DC OK, Fan fail, OTP等警報信號輸出
- 輸出電壓/電流調整範圍寬

PV : 1~120%

PC : 20~100%

